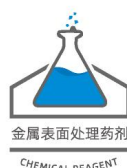
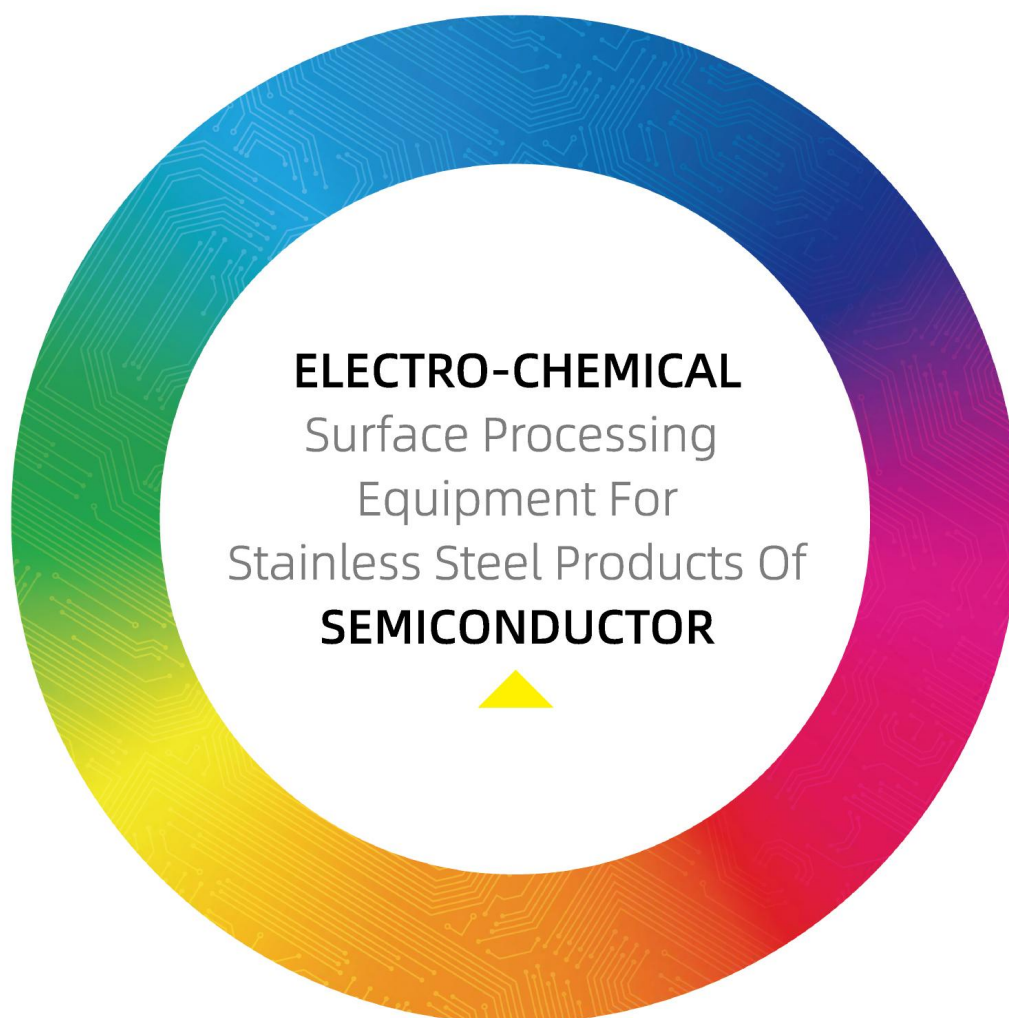


半导体级不锈钢电化学加工设备



ELECTRO-CHEMICAL SURFACE PROCESSING EQUIPMENT FOR STAINLESS STEEL PRODUCTS OF SEMICONDUCTOR
半导体级不锈钢产品电化学表面加工设备

ELECTROPOLISHING EQUIPMENT FOR VALVE BODY
OF STAINLESS STEEL

超洁净不锈钢阀体专用内电化学抛光设备

针对半导体用隔膜阀、球阀、减压阀等各类阀体内流道EP 加工专机设计，加工过程以及药水流动只作用于阀体内流道，不伤及或影响阀体外表面；满足SEMI F19 标准的相关质量等级要求。



EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

设备外形尺寸	1650mm(L) x 850mm(W) x 1800mm(H)	药液冷却方式	循环水强制冷却可选
设备总功率	12kw	电源冷却方式	风冷
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制	工作环境温度	-20 °C to 40 °C
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等	工作环境湿度	40% ~ 60%
工作方式	长期连续工作制	抛光方式	电化学抛光
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 36V, 输出电流: 0 ~ 300A	抛光部位	内部
加工参数控制精度	≤0.5%	加工件数	2 件/次

ELECTROLYTIC ABRASIVE POLISHING MACHINE
FOR STAINLESS STEEL

不锈钢复合研磨加工机床

通过MP+EP 两种抛光方式双重作用，即可达到极低的表面粗糙度：Ra 最低可≤0.01μm，Rz 最低可≤0.1μm；又能达到EP 级别的洁净度和耐腐蚀性能。



EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

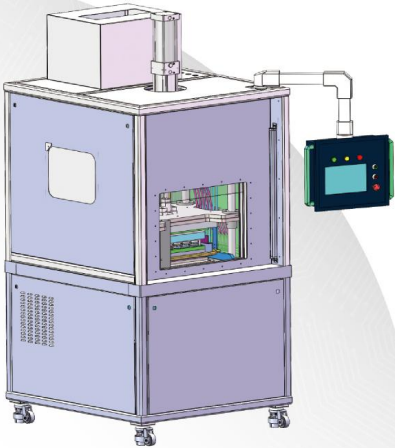
设备外形尺寸	依据产品情况而定	药液冷却方式	循环水强制冷却可选
设备总功率	5kw	电源冷却方式	风冷 / 水冷
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制	工作环境温度	-20 °C to 40 °C
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等	工作环境湿度	40% ~ 60%
工作方式	长期连续工作制	抛光方式	机械研磨+电化学研磨
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 80V, 输出电流: 0 ~ 100A	抛光部位	内部
加工参数控制精度	≤0.1%	加工件数	1 ~ 2件/次

ELECTRO-CHEMICAL SURFACE PROCESSING EQUIPMENT FOR STAINLESS STEEL PRODUCTS OF SEMICONDUCTOR
半导体级不锈钢产品电化学表面加工设备

ELECTROPOLISHING EQUIPMENT FOR FITTINGS
OF STAINLESS STEEL

超洁净不锈钢接头专用电化学抛光设备

针对半导体用各类接头内流道EP 加工专机设计，
加工过程以及药水流动只作用于接头内表面，不伤及或影响接头外表面；
满足SEMI F19 标准的相关质量等级要求。



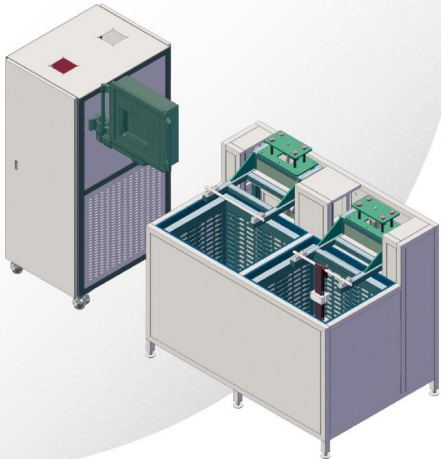
EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

设备外形尺寸	1050mm(L) x 1150mm(W) x 2250mm(H)	药液冷却方式	循环水强制冷却可选
设备总功率	8kw	电源冷却方式	风冷
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制	工作环境温度	-20 °C to 40 °C
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等	工作环境湿度	40% ~ 60%
工作方式	长期连续工作制	抛光方式	电化学抛光
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 36V, 输出电流: 0 ~ 500A	抛光部位	内部
加工参数控制精度	≤0.5%	加工件数	4 ~ 20 件/次

GENERAL ELECTROPOLISHING EQUIPMENT
FOR STAINLESS STEEL

常规不锈钢电化学抛光设备

针对半导体领域用不锈钢零部件的外电化学加工设计，
满足SEMI F19 标准的相关质量等级要求。



EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

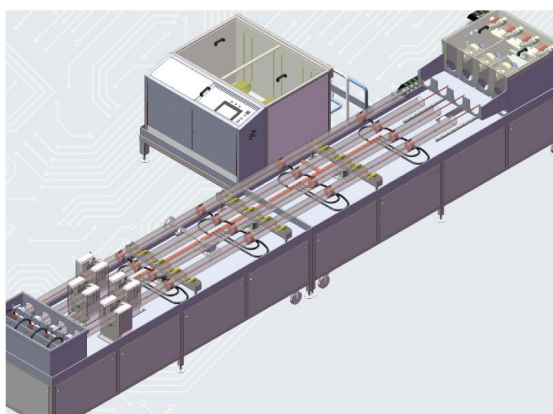
设备外形尺寸	1560mm(L) x 980mm(W) x 1280mm(H)	工作环境温度	-20°C to 40°C
设备总功率	45kw	工作环境湿度	≤80%
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制	上下摆动频率	14-50次/min (速度调)
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等	摆动幅度	50mm
工作方式	长期连续工作制	提升高度	700mm
药液冷却方式	循环水强制冷却可选	最大载重	50KG
电源冷却方式	风冷	抛光方式	电化学抛光
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 36V, 输出电流: 0 ~ 500A	抛光部位	外部
加工参数控制精度	≤0.5%	加工件数	依产品尺寸而定

ELECTRO-CHEMICAL SURFACE PROCESSING EQUIPMENT FOR STAINLESS STEEL PRODUCTS OF SEMICONDUCTOR
半导体级不锈钢产品电化学表面加工设备

ELECTROPOLISHING EQUIPMENT FOR STAINLESS
STEEL TUBE/PIPE OF SEMI GRADE

超洁净不锈钢管内壁电化学抛光设备（大管）

针对半导体领域用不锈钢管路内流道EP 加工设计，
EP 加工过程以及药水流动仅作用于管路内部，不影响产品外表面；
满足SEMI F19 标准的相关质量等级要求。



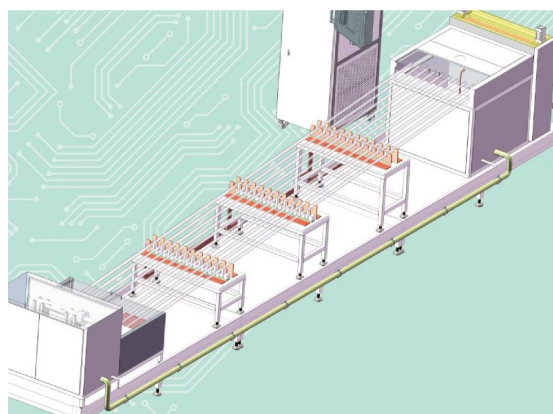
EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

设备外形尺寸	8100mm(L) x 1280mm(W) x 1350mm(H)
设备总功率	108kw
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等
工作方式	24 小时可连续工作
药液冷却方式	循环水强制冷却可选
电源冷却方式	风冷 / 水冷
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 24V, 输出电流: 0 ~ 6000A
加工参数控制精度	≤0.5%
设备使用环境	-20℃ to 40℃
工作环境湿度	≤80%
可加工尺寸	管径: $\phi 45 \sim \phi 250\text{mm}$; 长度: 4000-6000mm
抛光方式	电化学抛光
抛光部位	内部
加工件数	2 ~ 4 根/批
电极工作方式	固定式

ELECTROPOLISHING EQUIPMENT
FOR STAINLESS STEEL TUBE/PIPE OF SEMI GRADE

超洁净不锈钢管内壁电化学抛光设备（小管）

针对半导体领域用不锈钢管路内流道EP 加工设计，
EP 加工过程以及药水流动仅作用于管路内部，不影响产品外表面；
满足SEMI F19 标准的相关质量等级要求。



EQUIPMENT PARAMETERS 设备参数

设备外形尺寸	8160mm(L) x 1360mm(W) x 1500mm(H)
设备总功率	46kw
电气制式	动力系统:380V, 三相五线制; 控制系统:220V, 两相三线制
设备制作材质	316L、PTFE、PP、紫铜等
工作方式	24 小时可连续工作
药液冷却方式	循环水强制冷却可选
电源冷却方式	风冷 / 水冷
加工参数控制范围	输出电压: 0 ~ 24V, 输出电流: 0 ~ 2000A
加工参数控制精度	≤0.5%
设备使用环境	-20℃ to 40℃
工作环境湿度	≤80%
可加工尺寸	管径: $\phi 6 \sim \phi 38\text{mm}$; 长度: 4000-8000mm
抛光方式	电化学抛光
抛光部位	内部
加工件数	10 ~ 20根/批
电极工作方式	拉拔式

*可根据客户产品样式非标定制; 可协助设计EP 加工工装; 可配备前后处理清洗设备; 可配备纯水制备设备; 污水处理系统设备。



SHANGHAI MIRROR METAL SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Add: No.8, XinShun Road, Zhujing Town, JinShan District, Shanghai, China.
www.mirrorpolishing.com.cn E-mail: sales@mirrorglabrous.com
TEL:+86 21 54419140 54419141

上海脉诺金属表面处理技术有限公司

上海市金山区朱泾工业园区新顺路8号



公司网站

微信公众号